PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-223391

(43) Date of publication of application: 17.08.2001

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21)Application number: 2000-035644

(71)Applicant: NICHIA CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

08.02.2000

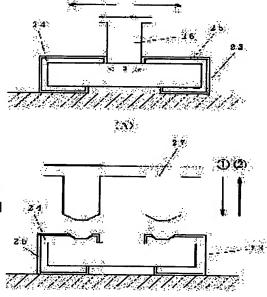
(72)Inventor: TAMEMOTO HIROAKI

(54) FORMING METHOD OF LIGHT-EMITTING DIODE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a forming method of a flip-chip type light-emitting diode where in the junction between an electrode of an LED chip and a lead electrode of a package is stabilized while thickness as a light-emitting diode is reduced for significantly improved mass-production efficiency as well as lower production cost.

SOLUTION: A part of the lead electrode is pressurized to raise other part, thus forming a protrusion for connection between the protrusion and the electrode of LED chip. Related to the junction between the electrode of LED chip and the lead electrode, the LED chip is fixed by melting/coagulation of a solder- plating, a cream solder, or a solder ball applied on the surface of lead electrode.



(B).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-223391 (P2001 - 223391A)

(43)公開日 平成13年8月17日(2001.8.17)

(51) Int.Cl.'

H01L 33/00

識別記号

FΙ H01L 33/00

テーマコート*(参考) N 5F041 С

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顧2000-35644(P2000-35644)

(22)出顧日

平成12年2月8日(2000.2.8)

(71)出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 為本 広昭

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

Fターム(参考) 5F041 AA42 AA43 AA47 CA05 CA34

CA46 CA76 DA03 DA09 DA20

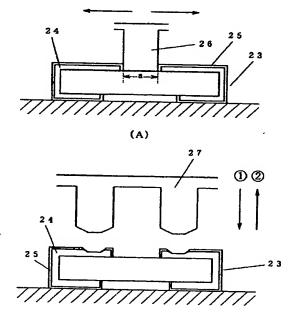
DA35 DA39 DA44 DA46

(54) 【発明の名称】 発光ダイオードの形成方法

(57)【要約】

【課題】 LEDチップの電極とパッケージのリード電 極部分との接合部分をより安定させると共に発光ダイオ ードとしてのさらなる薄型化を実現し、また量産効率を 大幅に向上させ、生産コストダウンも実現することが出 来るフリップチップ型発光ダイオードの形成方法を提供 することである。

【解決手段】 リード電極の一部分を押圧することによ り他の一部分を隆起させて突起部を形成し、該突起部と LEDチップの電極とを接続させる。またLEDチップ の電極とリード電極との接合部は、リード電極表面に施 された半田メッキ、あるいはクリーム半田、半田ボール を溶融・凝固させることで、LEDチップを固定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対のリード電極を有するパッケージ と、該一対のリード電極上に配置させるとともに電気的 に接続させたフリップチップ型LEDチップと、該LE Dチップを被覆する透光性樹脂とを有する発光ダイオー ドの形成方法であって、前記各リード電極の一部分を押 圧することにより他の一部分を隆起させて形成される突 起部上に、前記LEDチップの電極を配置させることを 特徴とする発光ダイオードの形成方法。

【請求項2】 少なくとも一対のリード電極を有するパ 10 ッケージと、該リード電極上に配置され、かつ電気的に 接続されたLEDチップとを有する発光ダイオードの形 成方法であって、前記LEDチップと電気的に接続させ る前記各リード電極の一部分を押圧することにより他の 一部分を隆起させて各リード電極表面に突起部を形成す る工程と、前記突起部を介してリード電極上にLEDチ ップを固定させる工程と、前記LEDチップ上に透光性 樹脂を配置する工程とを有する発光ダイオードの形成方

ド電極に半田メッキが施され、該リード電極とLEDチ ップとの接合部は、該半田メッキを溶融・凝固させるこ とでLEDチップを固定していることを特徴とする請求 項2に記載の発光ダイオードの形成方法。

【請求項4】 バッケージ表面に形成された一対のリー ド電極に、膜厚が1μm以下の金メッキが施され、さら に該リード電極表面にクリーム半田またはフラックスを 用いて半田ボールを供給し、該リード電極とLEDチッ プとの接合部は、該半田を溶融・凝固させることでしE Dチップを固定していることを特徴とする請求項2に記 30 載の発光ダイオードの形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一対のリード電極 を有するパッケージ上にLEDチップが配置された発光 ダイオードの形成方法に係わり、特に、前記各リード電 極の一部分に突起部を形成する工程を有する発光ダイオ ードの形成方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】発光ダイオードは、小型で効率が良く、 鮮やかな色の発光をする。また低消費電力であるほか、 - 半導体素子であるために球切れなどの心配がない。初期 駆動特性が優れ、振動やON/OFF点灯の繰り返しに 強いという特徴を有する。このような理由から、発光ダ イオードは近年特に、様々な分野で種々の光源として利 用されている。なかでも、LEDチップが半導体成膜用 基板上に形成された活性層面側の面と、LEDチップを 配置させるパッケージとが対向するように取り付けられ た構造(フリップチップ型)の発光ダイオードは、LE Dチップの半導体成膜用基板上に形成された活性層面側 50 おいては効率的ではなかった。

と反対の面が発光ダイオード上面を向いているためにチ ップ内での熱が発光ダイオード上方へと放熱される効果 が高く、ゆえに高電力消費が可能なため、特に多く用い られている。またLEDチップの電極とパッケージのリ ード電極とを直接接続するためチップを電気接続する際 に金線などを用いてワイヤーボンディングする必要がな いという理由、さらにそのワイヤが無い分LEDチップ とパッケージを合わせただけの厚みの発光ダイオードと でき薄型化が図れるという理由などから、量産されやす くまた広い分野で頻繁に利用されている。

【0003】近年、上記のように高密度実装が可能なし ED発光装置として、LEDチップとほぼ同等のサイズ を有するパッケージ、いわゆるCSP(Chip Sc ale Package)が注目されている。その一例 を図5に示す。とのCSPとしては従来、次に詳述する ようにフリップチップ接続方式(フェースダウンボンデ ィング法)を用いて形成される方法がある。

【0004】まず、ウェーハ状態のチョブの金属バッド にメッキまたは金ボール等(56)を付着させて突起部 【請求項3】 パッケージ表面に形成された一対のリー 20 分 (パンプ)を形成した後、ダイシングにより各チップ として切り離す。またこのチップ51が配置されるパッ ケージ53上にも、前記金属パッドと対応する位置に半 田バンブ57を形成させる。

> 【0005】次に上記パッケージを、フリップチップボ ンダの台上に空気吸引することにより固定させ、同時に 上記チップの方も、半導体成膜用基板上に形成された活 性層面側と反対の面 (チップの裏面) をフリップチップ ボンダのホルダで空気吸引して保持する。そしてホルダ 側を台上にゆっくりと接近させてチップ側のバンプ56 とパッケージ側のパンプ57を対向させ、位置を合わせ て密着・加圧し、両パンプの溶解温度に設定したリフロ ー炉内に通して、実際に両バンブを接合させる。その後 冷却させ、チップとパッケージとの間に出来た隙間、す なわち両パンプを合わせた高さだけの空間に、毛細管現 象を用いて樹脂58を充填する。 とのようにしてチップ とほぼ同等サイズのCSPが形成される。さらにその 後、LEDチップを外部から保護する目的、チップから の光を外部へと均等に取り出す等の目的で、透光性樹脂 55を用いてLEDチップ全体を封止する場合もある。 [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述のよ うな形成方法でできた発光ダイオードは、チップとパッ ケージとの間に出来る隙間を樹脂で充填することで両者 のパンプの接合部に加わる応力を緩和できるものの、そ の樹脂を毛細管現象等を利用して該隙間に注入するため 非常に多大な時間を要することとなり、量産性の向上を 妨げていた。それに前記隙間に樹脂を充填した後さらに 透光性樹脂を用いてLEDチップ全体を封止する場合、 樹脂注入という作業工程が二段階におよび、量産過程に

【0007】特にLEDチップ側のバンブに金メッキを用いた場合、バッケージ側の半田バンブとの接合部分は強度が低下しやすく、また濡れの状態も悪くなるため接合が不安定となるので、少なくともその接合部分に樹脂を注入して接合部分を保護し、安定させる必要性があった。

【0008】また、バンブには15~30μm厚さがありその形成には電気メッキが用いられるのが一般的であるが、このようにバンブ形成には薄膜被着、フォトリソグラフィ、エッチング、メッキ工程という特殊なプロセ 10スが必要で、そのために歩留まり低下やバンブ形成コストの上昇は避けられなかった。その上チップとバッケージの電極両方にバンブ形成を行うと大変な時間を要することとなり、効率的な大量生産が不可能であった。

【0009】さらに、チップとバッケージの電極両方にパンプ形成すると、バンプ形成工程にそれだけ時間を要するだけでなく、チップとバッケージの間に出来る隙間が大きくなり、発光ダイオードとしての薄型化を図るというフリップチップ型発光ダイオードの本来の目的を十分には果たせなくなっていた。

【0010】そこでこの発明は、上述のようなバンブ形成方法を用いずに、LEDチップを配置させるバッケージのリード電極上にバンブ的な突起部を容易に形成することができ、また発光ダイオードとしての薄型化も実現でき、さらに量産性を格段に向上させることができる発光ダイオードの形成方法を提供することを目的としている。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに本願発明者は、一対のリード電極を有するパッケー 30 ジと、該一対のリード電極上に配置させるとともに電気 的に接続させたフリップチップ型LEDチップと、眩し EDチップを被覆する透光性樹脂とを有する発光ダイオ ードの形成方法であって、前記各リード電極の一部分を 押圧することにより他の一部分を隆起させて形成される 突起部上に、前記LEDチップの電極を配置させること を特徴とする発光ダイオードの形成方法を発明した。ま たこの形成方法は、少なくとも一対のリード電極を有す るパッケージと、前記リード電極上に配置され、かつ電 気的に接続されたLEDチップとを有する発光ダイオー ドの形成方法であって、前記LEDチップと電気的に接 続させる該各リード電極の一部分を押圧することにより 他の一部分を隆起させて各リード電極表面に突起部を形 成する工程と、前記突起部を介してリード電極上にLE Dチップを固定させる工程と、前記LEDチップ上に透 光性樹脂を配置する工程とを有する発光ダイオードの形 成方法であり、さらに、パッケージ表面に形成された一 対のリード電極に半田メッキが施され、該リード電極と LEDチップとの接合部は、該半田メッキを溶融・凝固 することでLEDチップを固定していることを特徴とす 50

る発光ダイオードの形成方法である。また、バッケージ表面に形成された一対のリード電極に、膜厚が 1 μm以下の金メッキが施され、さらに該リード電極表面にクリーム半田またはフラックスを用いて半田ボールを供給し、該リード電極とLEDチップとの接合部は、該半田を溶融・凝固させることでLEDチップを固定していることを特徴とする発光ダイオードの形成方法である。

【0012】具体的にこの発明は、LEDチップを配置させるパッケージに一対のリード電極を形成した後、凸型ポンチ(押圧片)を用いて該リード電極の一部分を押圧することにより他の一部分を隆起させてパンプ的な突起部を形成させる方法である。これにより従来のように特殊なプロセス経てバンプを形成する必要がなくなり、容易にバンブ的な突起部を形成することが可能になり、量産効率を格段に向上させることができる。

【0013】またLEDチップは直接パッケージのリード電極に接続され、その接合部はリード電極に施された半田メッキを溶融・凝固することでLEDチップを固定させるか、あるいは膜厚が1μm以下の金メッキを施したリード電極表面にさらにクリーム半田またはフラックスを用いて半田ボールを施し、設半田を溶融・凝固させることでLEDチップを固定させるので、従来のように両者のバンプ同士を接続させる場合と違って接合部の積を広くとることができ、ゆえに接合部の安定感が増し、接合部補強のための樹脂をLEDチップとパッケージとの間にできる隙間に注入させる必要がなくなる。ゆえに、透光性樹脂を用いてLEDチップ全体を封止する場合でも、樹脂注入という作業工程が二段階に及ぶことはなくなった。

【0014】さらに、チッブ側の電極には突起部を形成せず、パッケージ側の電極のみに突起部を形成してLEDチップの電極と直接接続するので作業工程が効率化されるだけでなく、LEDチップとパッケージとの隙間が少なくなり、発光ダイオードとしての薄型化を図るというフリップチップ型発光ダイオードの本来の目的を十分に果たすことが出来る。発光ダイオードが様々な分野で種々の光源として利用されている今日においては、薄型化されればその使用用途や範囲をさらに広げることができる。本発明によれば、例えば携帯型ブリンターやスキャナー、またバックライト等種々の小型機器に組み込まれる光源として、現在よりも薄型の発光ダイオードを提供でき、またそれらは小型機器自体のさらなる小型化を実現させることできる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の一形態について図1~4に基づいて説明するが、これのみに限るということはない。

【0016】まず発光素子として、主発光ビークが47 0nmのGaInN半導体を用いた。LEDチップは、 洗浄させたサファイヤ基板上にTMG(トリメチルガリ

..

ウム)ガス、TMI(トリメチルインジュウム)ガス、窒素ガス及びドーパントガスをキャリアガスと共に流し、MOCVD法で窒化ガリウム系化合物半導体を成膜させることにより形成させた。ドーパントガスとしてSiH、とCp、Mgと、を切り替えることによってn型導電性を有する窒化ガリウム系半導体を形成しpn接合を形成させた。(なお、p型半導体は、成膜後400℃以上でアニールさせてある。)エッチングによりpn各半導体表面を露出させた後、スパッタリング法により各電極をそれたのでれ形成させた。こうして出来上がった半導体ウェハーをスクライブラインを引いた後、外力により分割させ発光素子として250μm角のLEDチップ11を形成させた。

【0017】次に、金型を用いてその内部に成形樹脂を 注入させ成形し、冷却後金型から取り出すことによりパ ッケージ13を形成させる。その後一対のリード電極1 4を、立体メッキを用いてパッケージ13の表面に沿う ようにして形成し、さらにそのリード電極表面に、半田 メッキ装置を用いて半田メッキ25を施した。こうして 20 できた一対のリード電極を有するバッケージ23(図 2) に加熱を施し、図2 (A) に示すように、形成した 両電極の間 a に向かって押圧片(凸形状のポンチ)26 をパッケージの上方より降下させ、リード電極の熱が冷 めないうちに両リード電極24を加圧するようにバッケ ージの左右方向(矢印方向)へと数回動かす。この作動 によりリード電極の加圧された部分は盛り上がり、図1 (A)のリード電極14の一部分である16のような、 LEDチップの電極とパッケージのリード電極とを直接 接続させるための突起部をごく容易に形成させることが 30 できる。

【0018】このような突起部はあるいは、図2(B)に示すように、一対のリード電極を有するバッケージ23に加熱を施した後、27のような形状の押圧片(凸形状のボンチ)をパッケージ上方からリード電極と4上に真っ直ぐに降下させ(矢印Φ)、リード電極に凹部を形成させた後、続いて押圧片27を真っ直ぐ上方に戻す(矢印Φ)。この作動によりリード電極を加圧して図1(B)17にみられるような凹部を形成することで、多少ではあるが同時に16の部分が盛り上がり(5~80μm盛り上がる)、その部分をLEDチップの電極とバッケージのリード電極とを直接接続させるための突起部とすることができる。

【0019】図4には、これらの方法で形成したいくつかのパターンの突起部の形状を、パッケージ上面から見た概略図で示してある(斜線部が突起部を示す)。図1の発光ダイオードのリード電極は、図4(a)に対応している。

【0020】これら比較的簡単な方法で従来のバンブに の封止部材は発光ダイオードの使用 代わるような突起部分をバッケージ側電極のみに形成す 50 て、用いなくてもよい場合もある。

るので、複雑なバンプ形成工程を削除でき、大幅なコス トダウンと効率的な量産が可能となる。また突起部分は パッケージ側電極のみに形成するので、従来のようにし EDチップとパッケージの電極両方にパンプ形成する場 合と比べると形成工程の時短が可能になり、またチップ とパッケージの間に出来る隙間を小さくできるので、発 光ダイオードとしての薄型化を図るというフェースダウ ン構造の本来の目的をより十分に果たすことができる。 【0021】次に図3に示すように、上述の方法でリー ド電極34の一部分に突起部36を形成したパッケージ 33を、フリップチップボンダの台上39に該突起部を 有する面が上面になるように配置して空気吸引すること により固定させ、同時に前述の方法で形成させておいた LEDチップ31の方も、半導体成膜用基板上に形成さ れた活性層面側と反対の面(チップの裏面)をフリップ チップボンダのホルダ38で空気吸引して保持する。そ してホルダ側を台上に接近させてチップ側の電極部32 とパッケージ側のリード電極突起部36を対向させ、位 置を合わせて密着・加圧し、先にバッケージのリード電 極表面に施しておいたメッキ層の溶解温度に設定したリ フロー炉内に通して、実際に両者をフェースダウン接合 させる。その後冷却させると、いったん溶解されたメッ **キ層が再び凝固し、それによってLEDチップをバッケ** ージのリード電極に直接接着・固定させることができ、 しかもその接合部の面積を比較的大きくとることができ るので、接合部の安定感が増す。あるいは、前述したリ ード電極表面に半田メッキを施す工程において、膜厚が lμm以下の金メッキをリード電極表面に施し、さらに 該リード電極表面にクリーム半田またはフラックスを用 いて半田ボールを供給し、該リード電極とLEDチップ との接合部を、該半田を溶融・凝固させることでLED チップを固定させても、同様の効果が得られる。この半 田ボールとは、粒径が、先述したような従来方法に用い られるパンプの厚みよりも小さい微粒子である。

【0022】またこのLEDチップとリード電極との接合の際に、わずかではあるがリード電極突起部分16付近に押し出された余分なメッキ、あるいは半田が、外部からの応力を吸収でき、両者の接合部分を補強する役割を果たす。

【0023】続いて透光性エポキシ樹脂15を封止部材として用い、細管からLEDチップが搭載されたバッケージ上に配置させ、少なくともLEDチップ全体と、LEDチップとバッケージ側電極との接合部分をすべて保護できるように封止した。LEDチップからの可視光と蛍光体からの蛍光との混色光を放射する発光ダイオードとする場合には、この封止部材に蛍光体を混合させてもよい。封止部材は、配置後150℃5時間にて硬化させ、図1のごとき発光ダイオードを形成させた。またこの封止部材は発光ダイオードの使用用途や環境に合わせて、用いなくてもよい場合もある

7

【0024】次に、図1に基づいて本発明による方法で 形成された発光ダイオードの各構成部について詳述す る。

【0025】(LEDチップ11)本発明に用いられる LEDチップ11には、例えば窒化物系化合物半導体な どが挙げられる。発光素子であるLEDチップは、MO CVD法等により基板上にInGaN等の半導体を発光 層として形成させる。半導体の構造としては、MIS接 合、PIN接合やpn接合などを有するホモ構造、ヘテロ構造あるいはダブルヘテロ構成のものが挙げられる。 半導体層の材料やその混晶度によって発光波長を種々選択することができる。また、半導体活性層を量子効果が 生ずる薄膜に形成させた単一量子井戸構造や多重量子井戸構造とすることもできる。

【0026】窒化ガリウム系化合物半導体を使用した場合、半導体基板にはサファイヤ、スピネル、SiC、Si、ZnO等の材料が用いられる。結晶性の良い窒化ガリウムを形成させるためにはサファイヤ基板を用いることが好ましい。このサファイヤ基板上にGaN、AIN等のバッファー層を形成しその上にpn接合を有する窒化ガリウム半導体を形成させる。窒化ガリウム系半導体は、不純物をドープしない状態でn型導電性を示す。発光効率を向上させるなど所望のn型窒化ガリウム半導体を形成させる場合は、n型ドーパントとしてSi、Ge、Se、Te、C等を適宜導入することが好ましい。一方、p型窒化ガリウム半導体を形成させる場合は、p型ドーパンドであるZn、Mg、Be、Ca、Sr、Ba等をドープさせる。

【0027】窒化ガリウム系化合物半導体は、p型ドーパントをドーブしただけではp型化しにくいためp型ドーパント導入後に、炉による加熱、低速電子線照射やプラズマ照射等により低抵抗化させることが好ましい。エッチングなどによりp型半導体及びn型半導体の露出面を形成させた後、半導体層上にスパッタリング法や真空蒸着法などを用いて所望の形状の各電極12を形成させる。

【0028】次に、形成された半導体ウェハー等をダイヤモンド製の刃先を有するブレードが回転するダイシングソーにより直接フルカットするか、又は刃先幅よりも広い幅の溝を切り込んだ後(ハーフカット)、外力によのて半導体ウェハーを割る。あるいは、先端のダイヤモンド針が往復直線運動するスクライバーにより半導体ウェハーに極めて細いスクライブライン(経線)を例えば碁盤目状に引いた後、外力によってウェハーを割り半導体ウェハーからチップ状にカットする。このようにして窒化ガリウム系化合物半導体であるLEDチップを形成させることができる。

【0029】本発明の発光ダイオードにおいて、封止部 記金属/ 材の樹脂に蛍光体を混合させることによって白色系を発 以外は、 光させる場合は、蛍光体との補色等を考慮して発光素子 50 させた。

の主発光波長は400nm以上530nm以下が好ましく、420nm以上490nm以下がより好ましい。 LEDチップと蛍光体との効率をそれぞれより向上させるためには、450nm以上475nm以下がさらに好ましい。

【0030】 (パッケージ13) パッケージ13は、金 型を用いてその内部に成形樹脂を注入させ成形し、冷却 後金型から取り出すことにより形成するのであるが、そ の成形樹脂としては、液晶ポリマーやPBT樹脂、ポリ アミド樹脂、ABS樹脂、メラミン樹脂等の絶縁性支持 部材を用いることができる。あるいはブリント基板のよ うな、エポキシ樹脂等を用いた積層板を用いてもよい。 【0031】(リード電極14) リード電極14として は、パッケージ上に配置されたLEDチップをパッケー シ外部と電気的に接続させるものであるため、電気伝導 性に優れたものが好ましい。具体的材料としては、ニッ ケル等のメタライズあるいはリン青銅、銅箔をエッチン グしたもの等の電気良導体を挙げることができる。また 本発明による発光ダイオードの場合、LEDチップとの 接着部材としてこのような材料の表面に、銀や金(特に 膜厚が 1 μm以下の金メッキ) あるいは錫系等の平滑な メッキを施してあるので、電極部材であると共にLED チップからの光を効率よく外部に放出させるように、そ の表面を光反射部材として利用することもできる。

【0032】(封止部材樹脂15) LEDチップ上に配置する封止部材15は、発光ダイオードの使用用途に応じてLEDチップ、LEDチップとパッケージ側リード電極との接合部などを外部から保護するためのものであるが、用途に応じて用いなくてもよい場合もある。封止30 部材は、各種樹脂や硝子などを用いて形成させることができる。

【0033】封止部材の具体的材料としては、主としてエポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーンなどの耐候性に優れた透明樹脂や硝子などが好適に用いられる。また、封止部材に拡散剤を含有させることによってLEDチップからの指向性を緩和させ視野角を増やすこともできる。拡散剤の具体的材料としては、チタン酸バリウム、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化珪素等が好適に用いられる。

【0034】以下、本発明によって形成された図1の発光ダイオードの効果を確認するため、図5のごとき発光ダイオードを形成させ、本発明による発光ダイオードとの比較実験を行った。図5の発光ダイオードは先述した従来方法のように、ウェーハ状態のチップの金属バッドにメッキまたは金ボール等を付着させて突起部分(バンブ)を形成した後ダイシングにより各チップとして切りはし、またこのチップが配置されるパッケージ上にも前記金属パッドと対応する位置に半田バンプを形成させた以外は、本発明による発光ダイオードと同様にして形成させた。

【0035】図1、図5の発光ダイオードのパッケージ のリード電極部分にそれぞれ突起部分 (バンブ) を形成 させる工程を同時にスタートさせ、両発光ダイオードの パッケージ1000個のリード電極にそれぞれ突起部分 (バンブ) の形成を施した。図1の発光ダイオードのバ ッケージ1000個の電極全てに突起部分形成を施すの に要した時間は約5秒であったが、図5の発光ダイオー ドの方には約30分を要した。さらに図5の発光ダイオ ードの場合LEDチップの電極にもバンプ形成を行った ので、それにも約30分を要し、合わせると約1時間を 10 図である(斜線部が突起部を示す)。 要したこととなった。また当然の事ながら、図1の発光 ダイオードはパッケージの電極にしか突起部分を形成し ていないので、図5の発光ダイオードの約75%の厚み しかなく、発光ダイオードのさらなる薄型化をも実現で きた。

[0036]

)

【発明の効果】本発明の、発光ダイオードのバッケージ 電極部に LEDチップを直接接続させるための突起部分 を、凸形状のポンチ (押圧片) で前記電極部の一部分を 押圧することにより形成することで、発光ダイオードの 20 15、55・・・封止部材樹脂 量産効率と生産コストダウンを格段に向上させることが でき、また発光ダイオードの薄型化を実現することがで きる。またLEDチップとパッケージのリード電極との 接合部は、リード電極に施された半田メッキを溶融・凝 固することでLEDチップを固定させるか、あるいは膜 厚がlμm以下の金メッキを施したリード電極表面にさ らにクリーム半田またはフラックスを用いて半田ボール を施し、該半田を溶融・凝固させることでLEDチップ を固定させるので、接合部の面積を広くとることがで き、ゆえに接合部の安定感を増すことができる。

* 【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は、本発明により形成された発光ダイオ ードの模式的断面図である。

【図2】 図2は、本発明である発光ダイオードの形成 過程の一部を、拡大して模式的に示した図である。

【図3】 図3は、本発明である発光ダイオードの形成 過程の一部を、拡大して模式的に示した図である。

【図4】 図4は、本発明により形成したいくつかのパ ターンの突起部の形状を、パッケージ上面から見た概略

【図5】 図5は、本発明による発光ダイオードとの比 較のために形成した発光ダイオードの模式的断面図であ る。

【符号の説明】

11、31、51・・・LEDチップ

12、32、52···LEDチップの電極部分

13、23、33、43、53・・・パッケージ

14、24、34、44、54・・・パッケージのリー 下電極

16、36、46・・・リード電極の突起部分

17・・・リード電極の凹部

25、35・・・メッキ層

26、27・・・凸型ポンチ (押圧片)

38・・・フリップチップボンダのホルダ

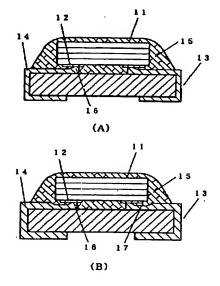
39・・・フリップチップボンダの台

56···LEDチップに付着させたパンプ

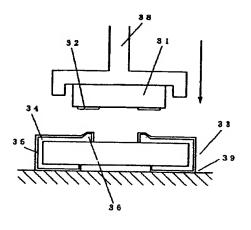
57・・・リード電極を有するパッケージ上に形成させ た半田バンプ

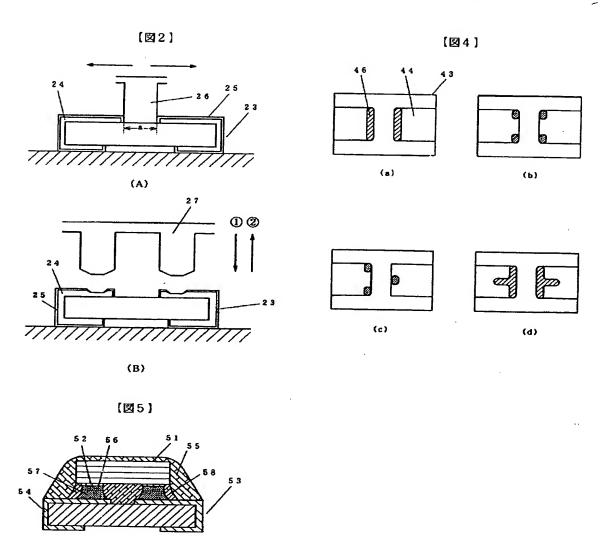
58・・・樹脂 ***** 30

【図1】



【図3】





BEST AVAILABLE COPY